

会社概要

(有)デザインシステム

ごあいさつ

色々な分野に於ける真空技術を応用し、技術の発展に貢献することを目的とし、2003年1月に設立、今日に至っております。

半導体及びFPDデバイスの研究開発用装置コンポーネンツの設計、製造に注力してまいりました。特殊装置の開発は、当社の技術に加え、お客様の技術のサポートが不可欠です。これまでお客様に大変お世話になってまいりました。心より感謝申し上げます。

私たちは、これからも、お客様の技術に貢献のできる製品を努力とともに創造していきます。

概要

社名 有限会社デザインシステム

所在地 190-1211

東京都西多摩郡瑞穂町石畑1690-2

TEL042-556-5933 FAX042-568-1886

代表取締役 鈴木 稔

設立 2003年1月

資本金 300万円

事業内容

- ・半導体及びFPD製造装置関連機器の設計、製造及び販売
- ・各種特殊開発装置（真空・常圧）及びコンポーネンツの設計、製造及び販売
- ・真空装置の改造及びメンテナンス

主な製品

- ・PE-CVD装置・各種スパッタリング装置・各種蒸着装置・酸化アニール炉
- ・イオンミリング装置・真空ロウ付炉・レーザー照射装置
- ・真空排気ユニット・真空搬送ユニット・水蒸気熱処理装置

製品例



EB蒸着装置



真空ロール装置



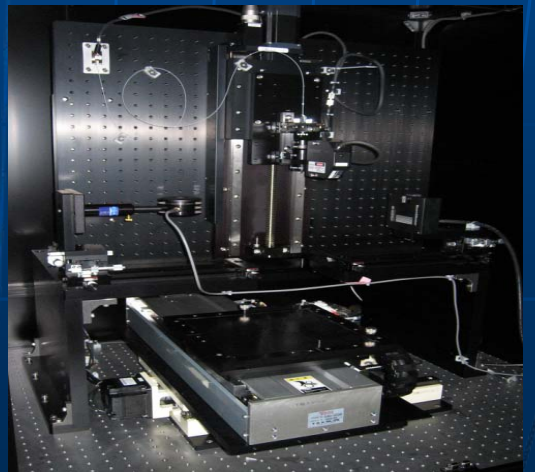
イオンミリング装置



真空搬送ユニット



真空排気ユニット



高速XYステージ